課題番号	:F-21-KT-0156
利用形態	:技術代行、機器利用
利用課題名(日本語)	:原子間力顕微鏡によるナノスケール表面下構造可視化
Program Title(English)	$: Nanometer-scale \ subsurface \ feature \ imaging \ using \ atomic \ force \ microscopy$
利用者名(日本語)	: <u>小林圭</u> ,船戸開
Username(English)	: <u>K. Kobayashi</u> , K. Funato
所属名(日本語)	:京都大学大学院工学研究科
Affiliation(English)	: Graduate School of Eng., Kyoto Univ.
キーワード/Keyword	:原子間力顕微鏡、ナノ構造、形状・形態観察、分析

<u>1. 概要(Summary)</u>

2005 年に Northwestern 大学の Dravid らにより、原 子間力顕微鏡(AFM)を用いた走杳型近接場超音波ホロ グラフィ(SNFUH)が開発され、表面下の構造物をナノス ケール分解能で可視化できることが報告された。われわ れも、ポリイミド基板上に散布した金ナノ粒子をフォトポリ マーのスピンコート膜で覆ったサンドイッチ構造試料を作 製し、SNFUH を用いて実験を行い、金ナノ粒子の可視 化が可能であることを確認した。SNFUH ではカンチレバ ーおよび試料を励振するが、カンチレバーの接触共振周 波数付近でカンチレバーだけを励振する超音波原子間 力顕微鏡(UAFM)や、試料だけを励振する原子間力音 響顕微鏡(AFAM)を用いても同様の結果が得られること を明らかにした。また最近、カンチレバーの熱振動ノイズ スペクトルを各点において測定する走査型熱振動顕微鏡 (Scanning Thermal Noise Microscopy: STNM)を開 発し、同試料の表面下構造の可視化に成功した。この STNM を用いて、ポリイミド基板上の金ナノ粒子だけでな く、シリコン基板上のポリスチレンナノ粒子も可視化可能で あることが分かった。しかしながら、これらの試料作製の段 階において、基板上に散布した粒子が基板に強く固定さr ていないことから、フォトポリマーをスピンコートする際に粒 子が基板から離れ、フォトポリマー中に分散してしまうこと がある。そのため場合、埋め込まれたナノ粒子の深さに揺 らぎが生じてしまうため、ナノ粒子を基板に強く固定する 方法、もしくはスピンコート以外のコーティング方法を検討 する必要が生じてきた。

そこで、ナノ粒子を基板上に散布した後、京都大学ナノ テクノロジーハブ拠点の設備を利用して、ポリパラキシレ ン(poly-para-xylylene: parylene) 膜を気相堆積によっ てコーティングすることで、粒子が意図した深さに埋め込 まれた試料の作製を試みた。 <u>2. 実験(Experimental)</u>

【利用した主な装置】

パリレン成膜装置

【実験方法】

ポリイミド基板上に粒径 50 nm と150 nm の金ナノ粒子 を散布した。まず、ポリイミド基板をアセトンに浸漬し、10 分間超音波洗浄を行った。洗浄した基板をエタノールに 浸漬し、さらに 10 分間超音波洗浄を行い、基板表面の付 着物を取り除いた。そして、30 分間 UV オゾン洗浄するこ とで、基板表面の有機物を取り除いた。次に、粒径 50 nm および 150 nm の金ナノ粒子が分散したコロイド溶液 10 µL を基板上に滴下した。3 分後、上澄みを吸い取り乾燥 させることで、金ナノ粒子を散布した。

ポリパラキシレンの特徴として、化学気相成長法 (chemical vapor deposition: CVD)を用いて容易に基 板表面にコーティングできることが挙げられる。モノマーが 基板表面に吸着し重合することで堆積し成膜するため、 微細な凹凸を有する基板表面にも均一にコンフォーマル コーティングすることが可能である。

パリレン成膜装置(SCS 社製 PDS-2010)を用いて、ポリ パラキシレンの成膜を行った。原料(日本パリレン合同会 社製 DPX-C)を0.4g 秤量し、パリレン成膜装置に投入し た。次に、原料を低圧下において 175°C で気化させた。 気化させたダイマー気体を 690°C で加熱し熱分解、得ら れたモノマー気体を室温において15 Paの蒸着室内に移 すことで、基板表面で重合、成膜した。

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

粒径 50 nm の金ナノ粒子をポリパラキシレン膜下に埋め 込んだ試料を AFAM により測定した。測定した AFAM 像を Fig. 1 に示す。Fig. 1(a) は表面形状像、Fig. 1(b) は振幅像、Fig. 1(c) は位相像、Fig. 1(d) は Fig. 1(a) 内の線 A-B に沿った断面プロファイルである。Fig. 1(a) および (d) より、金ナノ粒子直上に高さ 30 nm 程度の隆 起が確認された。これはポリパラキシレンのコンフォーマ ル堆積の特徴から表面形状が保存されたためだと考えら れる。

また、Fig. 1(b)の振幅像において、丸で囲ったように金 ナノ粒子が暗点として可視化に成功した。また、Fig. 1(c) の位相像において、丸で囲ったように金ナノ粒子が輝点と して可視化に成功した。



Fig. 1 AFAM images of Au nanoparticles buried under parylene film.



Fig. 2 STNM images of Au nanoparticles buried under parylene film.

STNM 像を Fig. 2 に示す。Fig. 2(a) は表面形状像、 Fig. 2(b) は接触共振周波数像、Fig. 2(c) は Fig. 2(b) 内の矢印の位置で得た接触共振周波数スペクトルである。 Fig. 2(b) の接触共振周波数像においてポリパラキシレン 膜下の金ナノ粒子が丸で示したように輝点として現れた。 Fig. 2(c) より、接触共振周波数は金ナノ粒子の存在しな い場所で 89.8 kHz、金ナノ粒子の直上で 91.3 kHz であ った。よって、金ナノ粒子直上において接触共振周波数 が正の方向におよそ 1.5 kHz シフトしていることが確認で きた。

<u>4. その他・特記事項(Others)</u>



[1] G. S. Shekhawat et al., Science 310, (2005) 89.

[2] K. Kimura et al., Ultramicroscopy 133, (2013)41.

[3] K. Kimura et al., Nanotechnology 27, (2016), 415707.

[4] A. Yao et al., Scientific Reports 7, (2018), 42718.

<u>5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)</u>

(1) 船戸開、木村邦子、小林圭、山田啓史、走査型 熱振動顕微鏡法による parylene 膜下に埋もれたナノ 粒子の可視化、第82回応用物理学会秋季学術講演 会、2021年9月13日、口頭発表

<u>6. 関連特許(Patent)</u> なし

次に、同じ場所を STNM により測定した。測定した